

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2005-532974 (P2005-532974A)

【公表日】平成 17 年 11 月 4 日 (2005.11.4)

【年通号数】公開・登録公報 2005-043

【出願番号】特願 2004-520511 (P2004-520511)

【国際特許分類】

**C 0 3 C 17/02 (2006.01)**

**C 0 3 B 8/02 (2006.01)**

**C 0 3 C 17/25 (2006.01)**

【F I】

C 0 3 C 17/02 B

C 0 3 B 8/02 A

C 0 3 B 8/02 B

C 0 3 C 17/25 A

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 8 月 1 日 (2005.8.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

アルコキシドが好ましくはテトラメチルオルトシリケート、テトラエチルオルトシリケート、テトラプロピルオルトシリケート、テトラブチルオルトシリケート、エチルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、又は前記のものの混合物の中から選択されている、請求項 1 記載の基板上へのガラス状膜の製造及び堆積方法。